



日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2003年 3月25日

出願番号 Application Number:

人

特願2003-082466

REC'D 2 2 JUL 2004

[ST. 10/C]:

[JP2003-082466]

出 願
Applicant(s):

独立行政法人理化学研究所

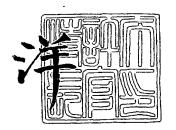
PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)



特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 7月 8日

ふ 四





【書類名】 特許願

【整理番号】 P6800

【提出日】 平成15年 3月25日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G02F 1/35

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県和光市広沢2番1号 理化学研究所内

【氏名】 渡部 裕輝

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県和光市広沢2番1号 理化学研究所内

【氏名】 川瀬 晃道

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県和光市広沢2番1号 理化学研究所内

【氏名】 碇 智文

【特許出願人】

【識別番号】 000006792

【氏名又は名称】 理化学研究所

【代理人】

【識別番号】 100097515

【住所又は居所】 東京都港区芝5丁目26番20号 建築会館4階 アサ

国際特許事務所

【弁理士】

【氏名又は名称】 堀田 実

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 027018

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1



【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9600194

【プルーフの要否】 要



【書類名】 明細書

【発明の名称】 テラヘルツ波分光計測によるターゲット判別方法及び装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 約1~3 THzのテラヘルツ波領域において、複数の異なる波長に対するターゲットの吸光度Sのスペクトル [S] を予め計測する分光スペクトル計測ステップと、

被対象物に前記各波長のテラヘルツ波を照射して、被対象物の吸光度 I を計測する被対象物分光計測ステップとを有し、

前記吸光度Sのスペクトル [S] と被対象物の吸光度Iのスペクトル [I] から、対象物の成分の有無を判別する、ことを特徴とするテラヘルツ波分光計測によるターゲット判別方法。

【請求項2】 前記吸光度Sのスペクトル [S] と被対象物の吸光度Iのスペクトル [I] から、ターゲット濃度 [P] を算出する濃度算出ステップを有する、ことを特徴とする請求項1に記載のターゲット判別方法。

【請求項3】 前記被対象物分光計測ステップにおいて、被対象物にテラヘルツ波を二次元的に走査して透過光の吸光度 I の二次元分布 [I] を計測し、前記濃度算出ステップにおいて、ターゲット濃度 P の二次元分布 [P] を算出する、ことを特徴とする請求項2に記載のターゲット判別方法。

【請求項4】 前記ターゲット濃度Pの二次元分布 [P] を二次元的に画像表示する、ことを特徴とする請求項2又は3に記載のターゲット判別方法。

【請求項5】 ターゲットの個数Mに対して、M以上のN種の異なる波長のテラ ヘルツ波を使用し、

N=Mの場合、式 $[P]=[S]^{-1}[I]$ により、ターゲット濃度Pの二次元分布 [P] を算出し、

N>Mの場合、式 [I]=[S] [P] から、最小2乗法によりターゲット濃度 P の二次元分布 [P] を算出する、ことを特徴とする請求項2乃至4に記載のターゲット判別方法。

【請求項6】 約 $1\sim3$ THzのテラヘルツ波領域において、複数の異なる波長のテラヘルツ波(4)を発生させるテラヘルツ波発生装置(12)と、該各波長



のテラヘルツ波を被対象物(10)にそれぞれ二次元的に走査する二次元走査装置(18)と、被対象物の吸光度 I の二次元分布 [I] を計測する分光計測装置(14)と、予め計測したターゲットの吸光度 S のスペクトル [S] と前記吸光度 I の二次元分布 [I] からターゲット濃度 I の二次元分布 [P] を算出するターゲット濃度演算装置(I 6)とを備えた、ことを特徴とするテラヘルツ波分光計測によるターゲット判別装置。

【請求項7】 ターゲット濃度Pの二次元分布 [P] を二次元的に画像表示する画像表示装置(20)を備える、ことを特徴とする請求項6に記載のターゲット判別装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、テラヘルツ波分光計測によるターゲット判別方法及び装置に関する

[0002]

【従来の技術】

周波数範囲が約0.5~3THzである遠赤外線あるいはサブミリ波の領域は、光波と電波の境界に位置しており、光波と電波がそれぞれの領域で発展してきたのとは対象的に、技術面及び応用面の両面で未開拓の分野として取り残されていた。しかし、無線通信におけるこの周波数帯(約0.5~3THz)の有効利用や超高速通信への対応、およびこの周波数帯の電磁波の特徴を生かしたイメージングやトモグラフィーによる環境計測、そして生物や医学への応用など、この領域は近年ますます重要となってきている。以下、この周波数帯(約0.5~3THz)の遠赤外線及びサブミリ波を「テラヘルツ波」と呼ぶ。

[0003]

なお、テラヘルツ波の発生手段に関しては、[非特許文献1] [非特許文献2] [特許文献1] [特許文献2] 等に開示されている。また、[非特許文献3] [非特許文献4] はその他の関連文献である。

[0004]



【非特許文献1】

S. Kawata, K. Sasaki, and S. Minami, "Component analysis of spatial and spectral patterns in multispectral images.

I. Basis, "J. Opt. Soc. Am. A4, 2101 (1987).

【非特許文献2】

K. Sasaki, S. Kawata, and S. Minami, "Component analysis of spatial and spectral patterns in multispectral images.

II. Entropy minimization, J. Opt. Soc.

Am. A6, 73 (1987).

[0005]

【非特許文献3】

河田聡、南茂夫、「科学計測のための画像処理」、第11章カラー画像と画像 分光処理、CQ出版社、P259-265

【非特許文献4】

泉美治他、「機器分析のてびき」、第1章赤外線吸収スペクトル法、化学同人 、P1-20

[0006]

【特許文献1】

特開2002-72269号公報

【特許文献2】

特開2003-5238号公報

[0007]

【発明が解決しようとする課題】

上述したテラヘルツ波の特徴の1つは、電波の物質透過性を有する最短波長域であり、かつ光波の直進性を備えた最長波長であるという点である。すなわち、電波のように様々な物質を透過することができ、電波帯では最も高い空間分解能



が得られ、かつ光波のようにレンズやミラーによる引き回しが可能である。

そのため、テラヘルツ波は、半導体、プラスチック、紙、ゴム、ビニル、木材、繊維、セラミック、コンクリート、歯、骨、脂肪、乾燥食品などを透過可能であり、X線に代わる人体に安全なイメージング手段として期待されている。

[0008]

近年、炭疽菌や薬物を郵便物として頒布する一種のテロ行為が社会問題化している。これらの内在物は、従来のX線写真では内在物の形状は判断できるがその特性は開封しない限り判断できない。そのため、例えば粉末状の炭疽菌や薬物はX線写真ではなんらの異常も検出できない問題点があった。

[0009]

本発明はかかる問題点を解決するために創案されたものである。すなわち、本発明の目的は、従来のX線写真では判断できなかった内在物の成分を、形状と共に、開封することなく、判別することができるテラヘルツ波分光計測によるターゲット判別方法及び装置を提供することにある。

[0010]

【課題を解決するための手段】

本発明によれば、約1~3 THzのテラヘルツ波領域において、複数の異なる波長に対するターゲットの吸光度Sのスペクトル[S]を予め計測する分光スペクトル計測ステップと、

被対象物に前記各波長のテラヘルツ波を照射して、被対象物の吸光度 I を計測する被対象物分光計測ステップとを有し、

前記吸光度Sのスペクトル [S] と被対象物の吸光度Iのスペクトル [I] から、対象物の成分の有無を判別する、ことを特徴とするテラヘルツ波分光計測によるターゲット判別方法が提供される。

[0011]

本発明の好ましい実施形態によれば、前記吸光度Sのスペクトル [S] と被対象物の吸光度Iのスペクトル [I] から、ターゲット濃度 [P] を算出する濃度算出ステップを有する。

また、前記被対象物分光計測ステップにおいて、被対象物にテラヘルツ波を二次



元的に走査して透過光の吸光度 I の二次元分布 [I] を計測し、前記濃度算出ステップにおいて、ターゲット濃度 P の二次元分布 [P] を算出する。

[0012]

また、本発明によれば、約 $1 \sim 3$ THzのテラヘルツ波領域において、複数の異なる波長のテラヘルツ波(4)を発生させるテラヘルツ波発生装置(1 2)と、該各波長のテラヘルツ波を被対象物(1 0)にそれぞれ二次元的に走査する二次元走査装置(1 8)と、被対象物の吸光度Iの二次元分布 [I] を計測する分光計測装置(1 4)と、予め計測したターゲットの吸光度Sのスペクトル [S] と前記吸光度Iの二次元分布 [I] からターゲット濃度Pの二次元分布 [P] を算出するターゲット濃度演算装置(1 6)とを備えた、ことを特徴とするテラヘルツ波分光計測によるターゲット判別装置が提供される。

[0013]

上記本発明の方法及び装置によれば、テラヘルツ波発生装置(12)により複数の異なる波長のテラヘルツ波(4)を発生させ、二次元走査装置(18)により波長のテラヘルツ波を被対象物(10)にそれぞれ二次元的に走査し、分光計測装置(14)により被対象物の吸光度Iの二次元分布 [I] を計測し、ターゲット濃度演算装置(16)により予め計測したターゲットの吸光度Sのスペクトル [S] と前記吸光度Iの二次元分布 [I] から画像分光によりターゲット濃度Pの二次元分布 [P] を算出することができる。

[0014]

従って、テラヘルツ波の吸収に波長依存性のあるターゲットが含まれた郵便物等を被対象物とすることにより、内在物の成分を開封することなく判別することができ、従来のX線写真では判断できなかった内在物の異常性を検出することができる。

[0015]

また、ターゲット濃度Pの二次元分布 [P] を二次元的に画像表示する画像表示装置 $(2\ 0)$ を備え、ターゲットの濃度 [P] を二次元的に画像表示することにより、被対象物 $(1\ 0)$ 内に存在する波長依存性のあるターゲットの形状をその分布と共に二次元的に画像表示することができる。



[0016]

ターゲットの個数Mに対して、M以上のN種の異なる波長のテラヘルツ波を使用し、N=Mの場合、式 $[P] = [S]^{-1}[I]$ により、ターゲット濃度Pの二次元分布 [P] を算出し、N>Mの場合、式 [I] = [S] [P] から、最小2乗 法によりターゲット濃度Pの二次元分布 [P] を算出する。

[0017]

この方法により、ターゲット数が複数ある場合でも、汎用性の高いPC等を用いて、吸光度 I の二次元分布 [I] である画像から、画像処理により、短時間に被対象物(10)内に存在する波長依存性のあるターゲットの形状をその分布と共に二次元的に画像表示することができる。。

[0018]

【発明の実施の形態】

以下に本発明の好ましい実施形態を図面を参照して説明する。なお、各図において、共通する部分には同一の符号を付し重複した説明を省略する。

[0019]

図1は、テラヘルツ波の発生原理図である。この図において、1は非線形光学結晶 (例えばLiNbO₃)、2はポンプ波 (例えばYAGレーザー光)、3はアイドラー波、4はテラヘルツ波である。

ラマン活性かつ遠赤外活性を有する非線形光学結晶 1 にポンプ波 2 を一定方向に入射すると、誘導ラマン効果(又はパラメトリック相互作用)により物質の素励起波(ポラリトン)を介してアイドラー波 3 とテラヘルツ波 4 が発生する。この場合、ポンプ波 2 (ω_p)、テラヘルツ波 4 (ω_T)、アイドラー波 3 (ω_i)の間には、式(1)で示すエネルギー保存則と式(2)で示す運動量保存則(位相整合条件)が成り立つ。なお、式(2)はベクトルであり、ノンコリニアな位相整合条件は、図の右上に示すように表現できる。

[0020]

$$\omega_{p} = \omega_{T} + \omega_{i}...(1)$$

$$\kappa_{\rm p} = \kappa_{\rm T} + \kappa_{\rm i}...(2)$$

[0021]



このとき発生するアイドラー波 3 とテラヘルツ波 4 は空間的な広がりを持ち、その出射角度に応じてそれらの波長は連続的に変化する。このシングルパス配置におけるブロードなアイドラー波及びテラヘルツ波の発生をTPG(THz-wave Paramatric Generation)と呼ぶ。

なお、基本的な光パラメトリック過程は、1個のポンプ光子の消滅と、1個のアイドラ光子および1個のシグナル光子の同時生成によって定義される。アイドラ光あるいはシグナル光が共振する場合、ポンプ光強度が一定のしきい値を超えるとパラメトリック発振が生じる。また、1個のポンプ光子の消滅と、1個のアイドラ光子および1個のポラリトンの同時生成が誘導ラマン散乱であり、広義のパラメトリック相互作用に含まれる。

[0022]

しかし、図1に示したシングルパス配置のテラヘルツ波発生装置で発生したテラヘルツ波は非常に微弱であり、しかもその大部分は、非線形光学結晶中を数百μm進む間に吸収されてしまうという問題がある。

[0023]

図2はこの問題を解決したテラヘルツ波発生装置の構成図である。この図に示すように、プロードなアイドラー波3に対して特定方向(角度 θ)に共振器を構成することで、特定方向のアイドラー波3の強度を高めることができる。この場合、共振器は高反射コーティングを施したミラーM1とM2からなり、回転ステージ5上にセットされ、共振器の角度を微調整することができる。また、2枚のミラーM1、M2はその半分のみに高反射コーティングを施し、残りは素通しでポンプ波2が通過するようになっている。なお、この図で6はテラヘルツ波4を外部に取り出すためのプリズム結合器である。

[0024]

図2に示したテラヘルツ波発生装置において、ポンプ波の結晶への入射角 θ をある範囲(例えば $1\sim2^\circ$)で変えると、結晶中でのポンプ波とアイドラ波のなす角が変化し、テラヘルツ波とアイドラ波のなす角度も変化する。この位相整合条件の変化により、テラヘルツ波は例えば約 $140\sim310~\mu$ mの間で連続波長可変性を備える。



[0025]

図3は、本発明のターゲット判別装置の全体構成図である。この図において、本発明のターゲット判別装置は、テラヘルツ波発生装置12、分光計測装置14、ターゲット濃度演算装置16、二次元走査装置18及び画像表示装置20を備える。

[0026]

テラヘルツ波発生装置12は、パラメトリック効果によってテラヘルツ波発生が可能な非線形光学結晶1と、非線形光学結晶1にポンプ光2を入射してアイドラー光3とテラヘルツ波4を発生させるポンプ光入射装置11と、発生するテラヘルツ波4の波長を変化させるスイッチング装置13とを有する。

[0027]

テラヘルツ波発生装置 12 は、この例では図 2 に示したテラヘルツ波発生装置である。またこの例でスイッチング装置 13 は、非線形光学結晶 1 及びミラーM 1、M2 を載せたステージを回転させ、ポンプ波の結晶への入射角 θ を変化させる回転ステージである。

この構成のテラヘルツ波発生装置12により、スイッチング装置13 (回転ステージ)により、約1~3THzのテラヘルツ波領域において、複数の異なる波長のテラヘルツ波4を発生させることができる。

[0028]

図3において、分光計測装置14は、分割器14a、集光レンズ14b及び分 光計測器15を備える。

分割器14aは、この例ではワイヤグリッドであり、テラヘルツ波4を一定の比率で計測光4aと参照光4bに分割する。計測光4aは、反射ミラー17a、17bを介して集光レンズ14bに導かれ、参照光4bは、反射ミラー17cを介して分光計測器15に導かれる。集光レンズ14bは、計測光4aを被対象物10に集光して照射し、被対象物10を透過した計測光4aは、分散レンズ14cにより拡径され分光計測器15に導かれる。集光レンズ14bと分散レンズ14cは、例えば焦点距離30mm前後のTPXレンズである。分光計測器15は、例えば検出素子を2つ内蔵するSiボロメータである。分光計測器15の出力



は、ターゲット濃度演算装置16に入力される。

[0029]

ターゲット濃度演算装置 1 6 は、例えば記憶装置を備えた P C であり、予め計測したターゲットの吸光度 S のスペクトル [S] と前記吸光度 I の二次元分布 [I] からターゲット濃度 P の二次元分布 [P] を算出する。

なお、式 $1\sim3$ から明らかなように、テラヘルツ波4に出力変動(Δ I)がある場合でも、出力変動(Δ I)は参照光4bの利用により自動的に補償されるので、出力変動を補正して被対象物10の透過率を常に正確に求めることができる

[0030]

被対象物10が郵便物である場合、郵便物の一般的な内在物である、紙、プラスチック、繊維等はテラヘルツ波の吸収に波長依存性がなく、異なる波長に対してほぼ同一の吸収率を示すことが知られている。

一方、アスピリン、ビタミン等の薬物や、炭疽菌のような生体粉末は、テラヘルツ波の吸収に波長依存性を有し、異なる波長に対して異なる吸収率を示す。この理由は明らかではないが、分子構造に由来する振動周波数がテラヘルツ帯付近に存在するためのと考えられている。

従って、上述したターゲット濃度演算装置16により、計測した透過率の相違からテラヘルツ波の吸収に波長依存性のあるターゲットの有無を検出し、波長依存性のあるターゲットの場合に、これを安全な装置内で開放し検査することができる。

[0031]

二次元走査装置18は、被対象物10を例えばx-y平面内で移動させ、被対象物10の表面に複数の異なる波長のテラヘルツ波4をそれぞれ二次元的に走査する。

画像表示装置20は、ターゲット濃度演算装置16で検出された2波長の透過率が相違する位置を二次元的に画像表示する。

[0032]

上述したターゲット判別装置を用い、本発明の方法は、分光スペクトル計測ステ



ップ(A)、被対象物分光計測ステップ(B)及び濃度算出ステップ(C)からなる。

[0033]

分光スペクトル計測ステップ(A)では、約 $1\sim3$ THzのテラヘルツ波領域において、複数の異なる波長に対するターゲットの吸光度Sのスペクトル [S] を予め計測して記憶する。

被対象物分光計測ステップ(B)では、被対象物に前記各波長のテラヘルツ波を 照射して、被対象物の吸光度 I を計測する。なお、このステップにおいて、被対 象物にテラヘルツ波を二次元的に走査して透過光の吸光度 I の二次元分布 [I] を計測するのがよい。

濃度算出ステップ(C)では、前記吸光度Sのスペクトル [S] と吸光度 I から、ターゲット濃度Pを算出する。なお、被対象物分光計測ステップ(B)で透過光の吸光度 I の二次元分布 [I] を計測した場合には、このステップにおいて、ターゲット濃度Pの二次元分布 [P] を算出する。また、算出されたターゲット濃度Pの二次元分布 [P] は、画像表示装置20を用いて二次元的に画像表示する。

[0034]

この図にDで示すように、試料が郵便物の一般的な内在物(紙、プラスチック 、繊維等)の場合には、透過率はほぼ一定の値を示す。

これに対して、この図において、5-アスピリン(A)、パラチノース(B) 、リボフラビン(C)は、周波数(波長λの逆数)に対する透過率の変化S(λ)がそれぞれ異なっており、テラヘルツ波の吸収に波長依存性を示している。本 発明ではこのような波長依存性を示す物質をターゲットとする。

[0035]

まず、本発明の原理を説明する。



最も簡単な例として、波長依存性を示す 2 つの物質 A、Bの濃度がそれぞれ P A,P B であり、物質 A の波長 λ_1 , λ_2 に対する透過率がそれぞれ S_A (λ_1), S_A (λ_2)、物質 B の波長 λ_1 , λ_2 に対する透過率がそれぞれ S_B (λ_1), S_B (λ_2) であるとする。この場合、波長 λ_1 , λ_2 の透過光の吸光度 I_1 , I_2 は式(3) (4)で示される。

[0036]

$$I_1 = S_A (\lambda_1) P_A + S_B (\lambda_1) P_B \cdot \cdot \cdot (3)$$

$$I_2 = S_A (\lambda_2) P_A + S_B (\lambda_2) P_B \cdot \cdot \cdot (4)$$

[0037]

式(3)(4)において、透過光の吸光度 I_1 , I_2 , S_A (λ_1) , S_A (λ_2) 、 S_B (λ_1) , S_B (λ_2) が既知であれば、上記連立方程式を解くことにより、 2つの物質 A 、 B の濃度 P_A , P_B を求めることができる。

[0038]

同様に、M個の物質の濃度Pの二次元分布が行列 [P] であり、各物質のN個の異なる波長(又は周波数)に対する吸光度Sのスペクトルが行列 [S] であり、各波長(又は周波数)に対する透過光の吸光度Iの二次元分布が行列 [I] であるとすると、式(5)が成り立つ。

$$[I] = [S] [P] \cdot \cdot \cdot (5)$$

[0039]

この場合、N個の周波数のテラヘルツ波で観測された画像は、式(6)のような 線形行列式で表すことができる。

[0040]

【数1】

$$\begin{bmatrix} I(1,1) & \cdots & I(1,L) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ I(N,1) & \cdots & I(N,L) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S(1,1) & S(1,M) \\ \vdots & \cdots & \vdots \\ S(N,1) & S(N,M) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P(1,1) & \cdots & P(1,L) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ P(M,1) & \cdots & P(M,L) \end{bmatrix}$$
(6)

[0041]

ここで [I] は観測画像を 1 次元的に並べ直した行べクトル I (f_1), I (f_2



), \cdots I (f_N) を縦に並べた行列、[S] は各物質のスペクトルを横に並べた行列、[P] は各物質パターンをベクトル表記 P_1 , P_2 , \cdots P_M を縦に並べた行列である。ここでL は画像のサイズである。

[0042]

式 (6) において、行列 [S] と [I] が既知であれば、式 (6) から [P] を求めることができる。

すなわち、N=Mの場合、式 $[P]=[S]^{-1}[I]$ により、ターゲット濃度 P の二次元分布 [P] を算出することができる。また、N>Mの場合、式 [I]=[S] [P] から、最小 2 乗法によりターゲット濃度 P の二次元分布 [P] を算出すると式 (7) となる。

[0043]

【数2】

 $[P] = ([S]^{\epsilon}[S])^{-1}[S]^{\epsilon}[I] \qquad \dots \qquad (7)$

[0044]

【実施例】

以下、本発明の実施例を説明する。

ターゲット物質として、図4に示したパラチノースと5-アスピリンを選択し、5枚の試験片(ペレット)を作成した。5枚のペレットは、ポリエチレン粉末に混ぜてパラチノース濃度が50%、40%、20%の3種類と、5-アスピリン濃度が50%、20%の2種類を用意した。各ペレットの厚さと重さは、同一であり、それぞれ1mm,0.2 gである。5枚の試験片は、図5に示す配置で薄いプラスチック板に両面テープで張り付け、本発明の被対象物10とした。

[0045]

濃度 50%のペレットを用いて、約 $1\sim3$ THzのテラヘルツ波領域において、波長(周波数)と吸光度 Sの関係スペクトル [S] を計測しコンピュータのメモリに記憶させた。このテラヘルツ分光特性は、図4と同様である。

[0046]



次に、図3に示した装置を用い、1.2~2.0 TH z のテラヘルツ波を被対象物 1.0 にそれぞれ二次元的に走査し、被対象物の吸光度 I の二次元分布 [I] を計測してコンピュータのメモリに記憶させるとともに、画像表示装置 2.0 で画像表示させた。

[0047]

図6は、テラヘルツ波の周波数を変え、被対象物の透過像を撮像したものである。なおこれらの画像のスケールは、透過したテラヘルツ波の強度を入射強度で割った値の対数をとったものである。

1. 2、1. 3、1. 4、1. 5、1. 6、1. 7、1. 8、1. 9、2. 0 T H z のテラヘルツ波で 5 枚の試験片 (ペレット) の濃淡に違いがあるのがわかる

[0048]

図7は、本発明の方法により、図6の6枚の画像から各物質の濃度分布を求めた図である。ここで行列[S]は、図4の分光データを使用した。また行列[S]は、50%の濃度の薬品サンプルを用いて測定したので、得られた成分パターンに50%を掛けて濃度を推定した。

図7において、(A) は5-アスピリンの濃度分布、(B) はパラチノースの濃度分布、(C) は被対象物に含まれていないリボフラビンの濃度分布、(D) は波長依存性を示さない紙、プラスチック、等の濃度分布である。この図から、被対象物10を構成する各ペレットの成分に対応した濃度分布が得られていることがわかる。すなわち成分の違いが分離され、その濃度の違いも抽出されている。

[0049]

上述した本発明の方法及び装置によれば、テラヘルツ波発生装置12により複数の異なる波長のテラヘルツ波4を発生させ、二次元走査装置18により波長のテラヘルツ波を被対象物10にそれぞれ二次元的に走査し、分光計測装置14により被対象物の吸光度Iの二次元分布[I]を計測し、ターゲット濃度演算装置16により予め計測したターゲットの吸光度Sのスペクトル[S]と前記吸光度Iの二次元分布[I]から画像分光によりターゲット濃度Pの二次元分布[P]を算出することができる。



[0050]

従って、テラヘルツ波の吸収に波長依存性のあるターゲットが含まれた郵便物等を被対象物とすることにより、内在物の成分を開封することなく判別することができ、従来のX線写真では判断できなかった内在物の異常性を検出することができる。

[0051]

また、ターゲット濃度Pの二次元分布 [P] を二次元的に画像表示する画像表示装置20を備え、ターゲットの濃度 [P] を二次元的に画像表示することにより、被対象物10内に存在する波長依存性のあるターゲットの形状をその分布と共に二次元的に画像表示することができる。

[0052]

なお、本発明は上述した実施形態に限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変更できることは勿論である。

[0053]

【発明の効果】

上述したように、本発明は、異なる周波数のテラヘルツ波で計測された画像セットから、既知のテラヘルツ分光データを用い、化学薬品などの成分の違いを空間パターンとして抽出するものであり、小包、封筒、不透明なプラスチック容器などに内部にある物質の成分パターンを分離し、その濃度を調べることができる。

[0054]

従って、本発明のテラヘルツ波分光計測によるターゲット判別方法及び装置は、従来のX線写真では判断できなかった内在物の成分を、形状と共に、開封することなく、判別することができる、等の優れた効果を有する。

【図面の簡単な説明】

【図1】

テラヘルツ波の発生原理図である。

【図2】

共振器を有するテラヘルツ波発生装置の構成図である。

【図3】



本発明のターゲット判別装置の全体構成図である。

【図4】

テラヘルツ波の周波数とターゲットの吸光度Sの関係図である。

【図5】

本発明の実施例を示す被対象物の模式図である。

【図6】

テラヘルツ波の周波数を変えて撮像した被対象物の透過像である。

【図7】

図6の6枚の画像から求めた各物質の濃度分布図である。

【符号の説明】

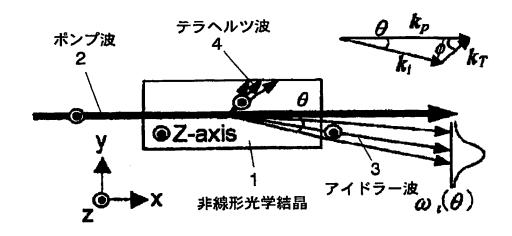
- 1 非線形光学結晶、2 ポンプ波、
- 3 アイドラー波、4 テラヘルツ波、
- 4 a 計測光、4 b 参照光、
- 5 回転ステージ、6 プリズム結合器、
- 10 被対象物、11 ポンプ光入射装置、
- 12 テラヘルツ波発生装置、
- 13 スイッチング装置(回転ステージ)、
- 14 分光スペクトル計測装置、
- 14a 分割器 (ワイヤグリッド)、14b 集光レンズ、
- 15 分光計測器 (Siボロメータ)、
- 16 ターゲット濃度演算装置 (PC)、
- 18 二次元走查装置、20 画像表示装置



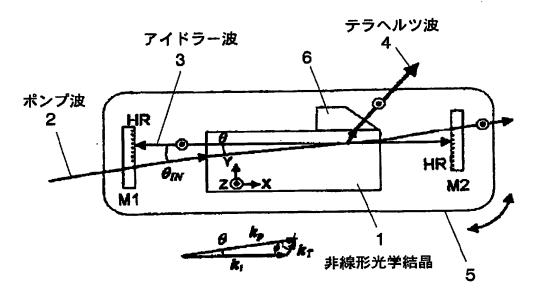
【書類名】

図面

【図1】

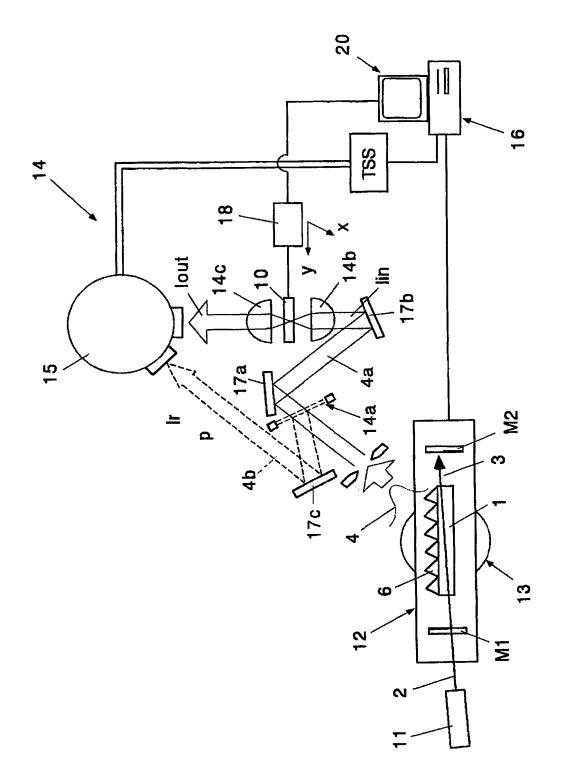


【図2】



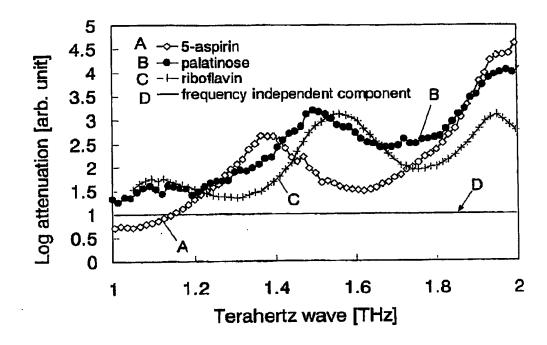


【図3】

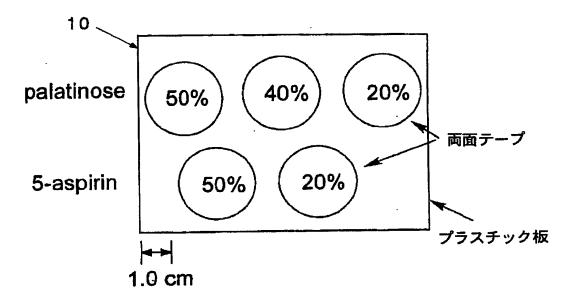




【図4】

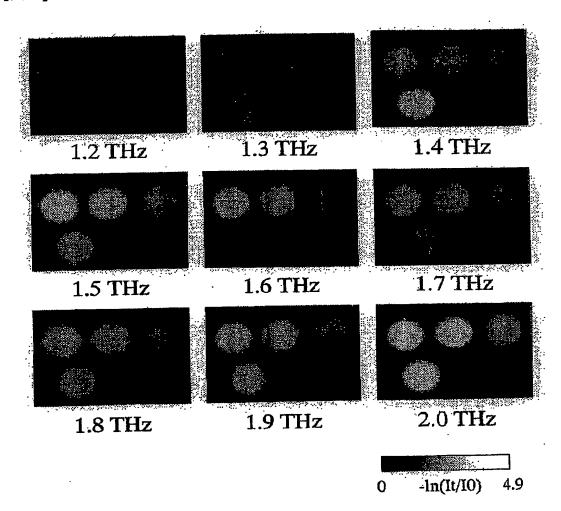


【図5】





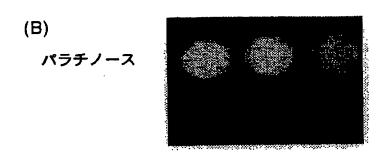
【図6】



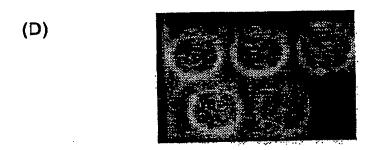


【図7】











【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 従来のX線写真では判断できなかった内在物の成分を、形状と共に、 開封することなく、判別することができるテラヘルツ波を用いたターゲット判別 方法及び装置を提供する。

【解決手段】 約1~3 TH z のテラヘルツ波領域において、複数の異なる波長に対するターゲットの吸光度 S のスペクトル [S] を予め計測する分光スペクトル計測ステップと、被対象物に前記各波長のテラヘルツ波を照射して、被対象物の吸光度 I を計測する被対象物分光計測ステップとを有し、吸光度 S のスペクトル [S] と被対象物の吸光度 I のスペクトル [I] から、対象物の成分の有無を判別する。

【選択図】 図4



【書類名】 出願人名義変更届(一般承継)

 【提出日】
 平成15年12月 1日

 【あて先】
 特許庁長官殿

【事件の表示】

【出願番号】

特願2003-82466

【承継人】

【識別番号】 503359821

【住所又は居所】 埼玉県和光市広沢2番1号 【氏名又は名称】 独立行政法人理化学研究所

【承継人代理人】

【識別番号】

100075812

【弁理士】

【氏名又は名称】 吉武 賢次

【提出物件の目録】

【物件名】

権利の承継を証明する書面 1

【援用の表示】 平成15年11月20日提出の特許第1575167号外98件

にかかる一般承継による特許権の移転登録申請書

【物件名】 登記簿謄本 1

【援用の表示】 平成15年11月20日提出の特許第1575167号外98件

にかかる一般承継による特許権の移転登録申請書

【物件名】 委任状 1



【物件名】

委任状

【添付書類】**()。

委 任 状



私は、

識別番号 100075812 弁理士 吉 武 賢 次 氏 を代理人と定めて下記事項を委任する。

95434

- 1. 別紙目録に記載の特許出願に関する出願人名義変更届をする件
- 2. 上記各項の手続を処理するため復代理人を選任及び解任する件

以上

平成 / 5 年 // 月 / 3 日

住所又は居所 埼玉県和光市広沢2番1

氏名又は名称 独立行政法人 理化学研

代表者 理事長野依良



目録(1)

```
1.
   特顯昭63-235737
                             特願平07-327372
                          51.
2.
   特顯平05-044143
                         52.
                             特願平08-000652
3.
   特願平05-127257
                         53.
                             特顧平08-026368
4.
   特願平05-127258
                         54.
                             特願平08-030850
                         55.
5.
   特願平05-213675
                             特顧平08-041279
   特願平05-306164
                         56.
6.
                             特願平08-045903
                         57.
7.
                             特願平08-051604
   特願平05-328611
   特願平05-336746
                         58.
                             特顯平08-065715
8.
9.
   特願平06-035100
                         59.
                             特願平08-070071
                         60.
10.
   特顯平08-061792
                             特顧平08-105667
                         61.
                             特願平08-107784
11.
   特願平06-061793
12.
   特顯平06-069150
                         62.
                             特願平08-116473
13.
   特願平06-097098
                         63.
                             特顧平08-123475
                             特願平08-127005
14.
   特願平06-111624
                         64.
15.
   特願平06-121100
                         65.
                             特願平08-131746
16.
   特願平06-145908
                         66.
                             特願平08-132846
   特願平06-158670
17.
                         67.
                             特願平08-132854
18.
   特顧平08-158671
                         68.
                             特願平08-142676
19.
   特願平06-165751
                         69.
                             特願平08-158078
20.
                         70.
   特願平06-165752
                             特願平08-167401
21.
                         71.
                             特願平08-196331
   特願平06-181857
22.
   特願平06-235742
                         72.
                             特願平08-197050
23.
   特願平06-238603
                         73.
                             特願平08-197051
24.
   特願平06-244764
                         74.
                             特願平08-211946
                          75.
25.
   特願平06-248486
                             特願平08-216506
   特顯平06-252942
26.
                          76.
                             特願平08-216508
27.
                          77.
                             特願平08-222352
   特願平06-268723
                          78.
                             特願平08-231066
28.
   特願平06-293933
                          79.
   特願平06-301372
                             特願平08-233442
29.
                          80.
30.
   特願平06-323795
                             特願平08-236685
31.
                          81.
                             特願平08-251410
   特願平06-324490
   特願平06-507966(不服2002-12420)82.
                             特願平08-262051
32.
33.
   特願平07-007185
                         83.
                             特願平08~302896
34.
   特願平07-069255
                          84.
                             特願平08-308335
                         85.
                             特願平08-308336
35.
   特願平07-082880
                          86.
                             特願平08-311467
36.
   特願平07-083142
                          87.
37.
   特顧平07-117933
                             特願平08-315093
38.
   特願平07-133487
                          88.
                             特願平08-317622
                          89.
39.
   特願平07-205141
                             特願平08-320241
40.
   特願平07-214659
                          90.
                             特願平08-506395
                          91.
                             特願平09-002295
41.
   特願平07-217276
   特願平07-236185
42.
                          92.
                             特願平0.9-010602
                          93.
                             特願平0~9-019968
43.
   特願平07-240684
   特願平07-249244
44.
                          94.
                             特願平0:9-019969
                         95.
45.
   特願平07-259922
                             特願平09-019971
                          96.
46.
   特願平07-282716
                             特願平09-024890
47.
   特願平07-302793
                          97.
                             特願平09-028982
48.
                          98.
                             特願平09-046824
   特願平07-306004
                         99.
                             特願平09-049254
49.
   特顧平07-311711
                         100.
50.
   特願平07-311715
                             特願平09-053478
```



目録(2)

101.	特顯平09-054595	151. 特願平10-045434
102.	特願平09-056654	152. 特願平10-049499
103.	特願平09-057342	153、 特願平10-049867
104.	特願平09-058774	154. 特願平10-051489
105.	特顯平09-067611	155. 特顧平10-051490
106.	特顧平09-074394	156、 特願平10-051491
107.	特願平09-080480	157. 特願平10-051492
108.	特願平09-082965	158. 特願平10-051493
109.	特願平09-091523	159. 特願平10-060740
110.	特願平09-091591	160. 特願平10-060741
111.	特願平09-091694	161. 特願平10-061895
112.	特願平09-096968	162. 特願平10-076139
113.	特願平09-099061	163. 特願平10-085207
114.	特願平09-099109	164. 特願平10-085208
115.	特願平09-104093	165. 特願平10-103083
116.	特願平09-119730	166. 特願平10-103115
117.	特願平09-129068	167. 特願平10-103671
118.	特願平09-134525	168. 特願平10-104093
119.	特願平09-147964	169. 特願平10-113493
120.	特願平09-155364	170. 特願平10-116378
121.	特願平09-159963	171. 特願平10-121456
122.	特顯平09-163630	172. 特願平10-127520
123.	特願平09-163631	173. 特願平10-136198
124.	特願平09-171924	174. 特顧平10-149603
125.	特願平09-175896	175. 特願平10-150494
126.	特願平09-180423	176. 特願平10-151245
127.	特願平09-189436	177. 特願平10-155838
128.	特願平09-198201	178. 特願平10-155841
129.	特願平09-208866	179. 特願平10-156104
130.	特願平09-221067	180. 特願平10-156108
131.	特願平09-228345	181. 特願平10-198313
132.	特願平09-230870	182. 特願平10-200280
133.	特願平09-253740	183. 特願平10-217132
134.	特願平09-256795	184. 特願平10-217180
135.	特願平09-271782	185. 特願平10-222837
136.	特願平09-291995	186. 特願平10-227939
137.	特願平09-297084	187. 特願平10-229591
138.	特顧平09-307627	188. 特顯平10-232520
139.	特願平09-308597	189. 特願平10-232590
140.	特願平09-309848	190. 特願平10-236009
141.	特願平09-327140	191、 特顧平10-237485
142.	特願平09-327609	192. 特額平10-238144
143.	特願平09-328742	193. 特顯平10-245293
144.	特願平09-360327	194. 特願平10-250598
145.	特顯平10-002030	195. 特願平10-250611
146.	特願平10-010471	196. 特願平10-252128
147.	特願平10-014152	197. 特願平10-260347
148.	特願平10-015690	198. 特願平10-260416
149.	特願平10-024892	199. 特願平10-268791
150.	特願平10-043335	200. 特願平10-269859
-545	, ,	



目録(3)

201.	特願平10-272529	251. 特願平11-135137
202.	特願平10-280351	252. 特願平11-135482
203.	特願平10-308533	253. 特願平11-143429
204.	特顯平10-309765	254. 特願平11-144005
205.	特願平10-311673	255. 特願平11-147097
206.	特願平10-311674	256. 特願平11-151099
207.	特願平10-311675	257. 特願平11-166247
208.	特願平10-314856	258. 特顧平11-173839
209.	特願平10-315751	259. 特顯平11-179278
210.	特願平10-318781	260. 特顯平11-186052
211.	特願平10-338897	261. 特顯平11-193235
		262. 特顏平11-224269
212.	特願平10-338898	
213.	特願平10-338899	
214.	特願平10-352428	264. 特願平11-225832
215.	特願平10-354665	265. 特願平11-225839
216.	特願平10-363297	266. 特願平11-226176
217.	特願平10-363329	267. 特願平11-234800
218.	特願平10-506788	268. 特願平11-240325
219.	特願平10-532832	269. 特願平11-240910
220.	特顧平10-535583	270. 特願平11-241737
221.	特願平11-008183	271. 特願平11-242438
222.	特願平11-013380	272. 特願平11-242490
223.	特顯平11-015176	273. 特願平11-253851
224.	特願平11-031724	274. 特願平11-260947
225.	特顧平11-035776	275. 特願平11-277759
226.	特顯平11-046372	276. 特願平11-278976
227.	特顧平11-055835	277. 特願平11-279324
228.	特顧平11-055867	278. 特願平11-281632
229.	特顧平11-055930	279. 特願平11-303976
230.	特顯平11-056957	280. 特顯平11-309616
231.	特願平11-057381	281. 特願平11-315036
232.	特願平11-057749	282. 特願平11-321282
233.	特顧平11-058103	283. 特願平11-336079
234.	特願平11-061079	284. 特願平11-346467
235.	特願平11-061080	285. 特願平11-354563
236.	特顧平11-064193	286. 特顯平11-360274
237.	特願平11-064372	287. 特顧平11-365899
238.	特願平11-064506	288. 特願平11-373483
239.	特願平11-065136	289. 特願平11-510791
240.	特願平11-074385	290. 特願平11-515324
241.	特願平11-081225	291. 特願2000-001783
242.	特顯平11-090383	292. 特顧2000-005221
243.	特願平11-091875	293. 特顧2000-009363
244.	特願平11-103231	294. 特願2000-010516
245.	特顯平11-104509	295. 特願2000-011147
246.	特願平11-106920	296. 特顯2000-011623
247.	特願平11-106920 特願平11-124187	297. 特願2000-016518
248.	特願平11-130771	298. 特願2000-016622
249.	特願平11-130814	299. 特願2000-017112
250.	特顯平11-130815	300. 特願2000-018612
HOU.	TO BOX 1 O O O - O	



目録(4)

301.	特願2000-019195	351. 特願2000-141763
302.	特願2000-019528	352. 特願2000-148843
303.	特願2000-020067	353. 特願2000-152455
304.	特願2000-030321	354. 特願2000-152469
305.	特願2000-034109	355. 特願2000-154484
306.	特願2000-039082	356. 特顧2000-161895
307.	特願2000-040355	357. 特顧2000-163122
308.	特願2000-041927	358. 特願2000-164584
309.	特願2000-041929	359. 特顧2000-179723
310.	特願2000-045318	360. 特願2000-181281
311.	特願2000-045855	361. 特顧2000-184259
312.	特願2000-051488	
313.		362. 特顧2000-184295
	特願2000-051650	363. 特願2000-191007
314.	特願2000-052040	364. 特願 2000-191265
315.	特願2000-053707	365. 特顧2000-192332
316.	特願2000-054949	366. 特顧2000-193817
317.	特願2000-056093	367. 特顧2000-195384
318.	特願2000-056879	368. 特願2000-196991
319.	特願2000-057564	369. 特願2000-197022
320.	特願2000-057565	370. 特願2000-202801
321.	特願2000-057566	371. 特願2000-216457
322.	特願2000-058133	372. 特願2000-223714
323.	特願2000-058282	373. 特顧2000-224970
324.	特願2000-062316	374. 特顧2000-225486
325.	特願2000-064142	375. 特顧2000-225864
326.	特願2000-064209	376. 特願2000-225978
327.	特願2000-071119	377. 特顧2000-226361
328.	特願2000-076122	378. 特願2000-229191
329,	特願2000-085874	379. 特願2000-230551
330.	特願2000-089078	380. 特願2000-237165
331.	特願2000-092693	381. 特願2000-237166
332.	特願2000-100395	382. 特願2000-237533
333.	特願2000-105139	383. 特願2000-246309
334.	特願2000-105917	384. 特願2000-248331
335.	特願2000-107160	385. 特願2000-249232
336.	特顧2000-108409	386. 特顧2000-256149
337.	特顧2000-109638	387. 特願2000-257080
338.	特願2000-109954	388. 特願2000-257083
339.	特願2000-118361	389. 特顧2000-260030
340.	特願2000-120874	390. 特顯2000-261233
341.	特顯2000-123634	391. 特願2000-264743
342.	特願2000-128431	392. 特顧2000-265344
343.	特願2000-131049	393. 特顧20,00-278502
344.	特願2000-131050	394. 特願2000-279557
345.	特顧2000-131745	395. 特顯2000-292422
346.	特願2000-134427	396. 特顯2000-292832
347.	特願2000-136551	397. 特願2000-299812
348.	特願2000-136572	398. 特顯2000-307464
349.	特願2000-138977	399. 特願2000-308248
350.	特願2000-141566	400. 特願2000-309581
		14



目録(5)

401.	特願2000-319775	451. 特願2001-071435
402.	特願2000-322056	452. 特願2001-072650
403.	特願2000-333311	453. 特願2001-072668
404.	特願2000-334686	454. 特願2001-072963
405.	特願2000-334969	455. 特顧2001-073028
406.	特願2000-343912	456. 特願2001-074964
407.	特願2000-347398	457. 特願2001-074965
408.	特願2000-347865	458. 特願2001-077257
409.	特願2000-358121	459. 特顯2001-078671
410.	特顧2000-368566	460. 特願2001-084173
411.	特願2000-374626	461. 特願2001-089541
412.	特願2000-375090	462. 特願2001-091911
413.	特願2000-378421	463. 特願2001-092337
414.	特願2000-378942	464. 特顧2001-116171
415.	特願2000-378950	465. 特願2001-124294
416.	特願2000-384771	466、 特願 2 0 0 1 - 1 2 4 4 5 2
417.	特願2000-387016	467. 特顧2001-127575
418.	特願2000-394815	468. 特願2001-127576
419.	特顧2000-396445	469. 特願2001-135357
420.	特願2000-399940	470. 特願2001-137087
421.	特顧2000-400336	471. 特願2001-138103
422.	特顯2000-401110	472. 特願2001-142583
423.	特願2000-401245	473. 特願2001-147081
424.	特願2000-401258	474. 特顧2001-152364
425.	特願2000-503838	475. 特顧2001-152379
426.	特願2000-571733	476. 特願2001-153447
427.	特願2000-571943	477. 特願2001-155572
428.	特願2000-602588	478. 特願2001-163740
429.	特願2000-602900	479. 特願2001-164819
430.	特願2000-618709	480. 特願2001-164997
431.	特顧2001-003476	481. 特願2001-165133
432.	特顧2001-005615	482. 特願2001-167910
433.	特顧2001-007979	483. 特顧2001-168784
434.	特顧2001-016626	484. 特顧2001-171705
435.	特顧2001-025030	485. 特顧2001-173331
436.	特顧2001-037141	486. 特顧2001-174421
437.	特願2001-037147	487. 特願2001-174553
438.	特願2001-042501	488. 特願2001-175898
439.	特顧2001-044933	489. 特顧2001-178169
440.	特顧2001-047762	490. 特顧2001-179858
441.	特願2001-050645	491. 特願2001-180552
442.	特願2001-053550	492. 特顧2001-180554
443.	特願2001-054717	493. 特願2001-187735
444.	特願2001-059115	494. 特願2001-197185
445.	特願2001-059892	495. 特顧2001-197897
446.	特願2001-060848	496. 特顧2001-200854
447.	特願2001-062703	497. 特願2001-201356
448.	特顯2001-065799	498. 特顧2001-202971
449.	特願2001-065917	499. 特願2001-203089
4 50.	特願2001-068285	500. 特願2001-206505



目録(6)

501.	特願2001-206522	551. 特願2001-325367
502.	特顯2001-206523	552. 特願2001-326872
503.	特願2001-209305	553. 特願2001-327853
504.	特願2001-212947	554. 特願2001-329023
505.	特願2001-216505	555. 特願2001-332168
506.	特願2001-220219	556. 特願2001-337467
507.	特願2001-226176	557. 特顯2001-339396
508.	特願2001-228287	558. 特願2001-339593
509.	特願2001-228374	559. 特顧2001-346035
510.	特願2001-235412	560. 特願2001-347316
511.	特願2001-235747	561. 特願2001-347637
512.	特願2001-238951	562. 特願2001-349614
513.	特願2001-241023	563. 特願2001-351730
514.	特願2001-243930	564. 特願2001-352189
515.	特願2001-246642	565. 特願2001-353038
516.	特願2001-249976	566. 特願2001-358446
517.	特願2001-254377	567. 特顧2001-358581
518.	特願2001-254378	588. 特願2001-359710
519.	特顧2001-255589	569. 特願2001-374928
520.	特願2001-256576	570. 特願2001-376591
521.	特願2001-257188	571. 特顧2001-378757
522.	特顯2001-261158	572. 特願2001-380473
523.	特願2001-266004	573. 特願2001-382537
524.	特願2001-266069	574. 特顯2001-382539
525.	特願2001-266454	575. 特願2001-382599
526.	特顧2001-267194	576. 特顧2001-385258
527.	特願2001-267379	577. 特顧2001-385512
528.	特願2001-267863	578. 特顯2001-385513
529.	特顧2001-272977	579. 特願2001-385538
530.	特願2001-273964	580. 特願2001-388116
531.	特願2001-276053	581. 特願2001-390122
532.	特願2001-279406	582. 特願2001-392087
533.	特願2001-280319	583. 特願2001-392088
534.	特願2001-285145	584. 特願2001-395196
535.	特願2001-291059	585. 特願2001-396120
536.	特願2001-292223	586. 特願2001-397762
537.	特願2001-292224	587. 特顧2001-397998
538.	特願2001-293000	588. 特願2001-401139
539.	特顧2001-293054	589. 特顧2001-515803
540.	特願2001-293936	590. 特願2.001-523852
541.	符願2001-294013	591. 特願2001-557672
542.	特願2001-298140	592. 特願2002-000993
543.	特願2001-298402	593. 特願2002-005746
544.	特願2001-307340	594. 特願2002-010344
545.	特願2001-309501	595. 特願2002-011558
546.	特願2001-309508	596. 特顧2002-019752
547.	特願2001-309984	597. 特願2002-020329
548.	特願2001-310554	598. 特願2002-022499
549.	特願2001-313430	599. 特願2002-028046
550.	特願2001-319360	600. 特願2002-028109



目 録(7)

601.	特願2002-040151	651. 特願2002-162157
602.	特願2002-042829	652. 特願2002-162211
603.	特願2002-044340	653. 特顯2002-162365
604.	特願2002-044640	654. 特願2002-167759
605.	特願2002-046188	655. 特願2002-170068
606.	特願2002-047799	656. 特願2002-170902
607.	特願2002-053190	657. 特願2002-176435
608.	特願 2 0 0 2 - 0 5 3 5 7 5	658. 特願2002-176583
609.	特願2002-055272	659. 特顧2002-170333
610.	特願2002-057253	660. 特顧2002-185966
611.	特願2002-057565	661. 特願2002-187362
612.	特願2002-057935	662. 特願2002-187957
613.	特願2002-057963	663. 特願2002-188281
614.	特願2002-066249	664. 特願2002-189265
615.	特顧2002-070624	665. 特願2002-194627
616.	特顧2002-070987	666. 特顧2002-197812
617.	特願2002-071924	667. 特願2002-137812
618.	特顧2002-074902	668. 特顧2002-201575
619:	特願2002-074902	669. 特願2002-201373
620.	特顧 2 0 0 2 - 0 8 1 4 6 7	670. 特願2002-202116
621.	特願2002-081502	671. 特顧2002-205825
622.	特願2002-083081	672. 特顧2002-217714
623.	特願2002-084139	673. 特顧2002-221188
624.	特願2002-085017	674. 特顧2002-225469
625.	特願2002-087342	675. 特顧2002-225724
626.	特願2002-094681	676. 特願2002-226859
627.	特願2002-095132	677. 特顧2002-227286
628.	特願2002-095389	678. 特願2002-229686
629.	特願2002-100431	679. 特願2002-230562
630.	特願2002-106561	680. 特願2002-235294
631.	特願2002-119320	681. 特顧2002-235737
632.	特願2002-120371	682. 特顧2002-236838
633.	特願2002-123347	683. 特願2002-237058
634.	特願2002-128854	684. 特顯2002-237092
635.	特願2002-133717	685. 特願2002-248946
636,	特願2002-133749	686. 特願2002-253322
637.	特顧2002-134313	687. 特願2002-253689
638.	特願2002-141187	688. 特顧2002-253697
639.	特願2002-141438	689. 特願2002-254096
640.	特顧2002-142260	690. 特願2002-257924
641.	特願2002-149471	691. 特顧2002-260788
642.	特願2002-149931	692. 特願2002-261499
643.	特願2002-150541	693. 特顧2002-264969
644.	特願2002-154688	694. 特顧2002-267114
645.	特願2002-154695	695. 特願2002-268987
646.	特願2002-154823	696. 特願2002-270917
647.	特願2002-158237	697. 特願2002-271375
648.	特願2002-158352	698. 特願2002-271473
649.	特願2002-160277	699. 特願2002-273996
650.	特願2002-162148	700. 特願2002-274469



目録(8)

701. 特願2002-276051 751. 特願2003-012738 702. 特顧2002-282746 752. 特願2003-012774 703. 特顧2002-286487 753. 特願2003-015968 704. 特願2002-289209 754. 特願2003-016044 705. 特顯2002-295332 755. 特願2003-016940 706. 特願2002-296911 756. 特願2003-017397 707. 特顧2002-299429 757. 特願2003-021499 708. 特願2002-301875 758. 特願2003-024347 709. 特願2002-303838 759. 特願2003-024620 710. 特願2002-312131 760. 特願2003-025277 711. 特願2002-320102 761. 特願2003-027647 712. 特顧2002-320704 762. 特顯2003-027648 713. 特願2002-325909 763. 特願2003-031882 714. 特願2002-325920 764. 特顧2003-032932 715. 特願2002-332232 765. 特額2003-038206 716. 特願2002-339344 766. 特願2003-040642 717. 特願2002-339392 767. 特願2003-043961 718. 特願2002-339541 768. 特願2003-050153 719. 特顯2002-339551 769. 特願2003-050446 720. 特願2002-341195 770. 特顧2003-052520 721. 特願2002-343807 771. 特顧2003-052602 722. 特願2002-344279 772. 特願2003-052613 723. 特願2002-345597 773. 特願2003-052877 724. 特願2002-347401 774. 特願2003-053023 725. 特願2002-348760 775. 特願2003-054182 特願2002-349042 726. 776. 特願2003-054798 727. 特願2002-354594 777. 特願2003-054799 728. 特顧2002-357768 778. 特顧2003-054846 729. 特願2002-357900 779. 特願2003-054847 730. 特願2002-358019 780. **特願2003-054848** 731. 特願2002-358967 781. 特願2003-054849 732. 特願2002-360972 782. 特願2003-055452 733. 特願2002-360975 783. **特願2003-056628** 特願2002-368112 734. 784. 特願2003-061426 735. 特願2002-376555 785. 特願2003-063532 736. 特願2002-376774 786. 特顯2003-065013 737. 特顧2002-376831 787. 特顧2003-071028 特顧2002-379214 738. 788. 特顧2003-072979 739. 特顧2002-380624 789. 特願2003-074168 740. 特顧2002-38188 790. 特顧2003-076107 741. 特願2002-382170 791. 特顧2003-078999 742. 特願2002-383870 792. 特願20:03-079598 743. 特願2002-521644 793. 特願2003-079613 744. 特願2002-532458 794. 特願2003-082466 745. 特願2002-546564 795. 特願2003-083318 746. 特願2002-548185 796. 特顧2003-083433 747. 特願2002-570743 797. 特願2003-083480 748. 特願2003-003450 798. 特顧2003-085193 749. 特願2003-012550 799. 特願2003-089026 750. 特願2003-012694 800. 特願2003-090331



目録(9)

801.	特願2003-091446	851. 特顧2003-127135
802.	特願2003-092654	852. 特顧2003-127150
803.	特願2003-093642	853. 特願2003-128818
804.	特願2003-094272	854. 特願2003-128897
805.	特願2003-094719	855. 特願2003-129347
806.	特願2003-095770	856. 特願2003-131313
807.	特顧2003-095884	857. 特願2003-132280
808.	特願2003-095885	858. 特顧2003-132605
809.	特願2003-095886	859. 特願2003-132606
810.	特願2003-095904	860. 特顧2003-135591
811.	特願2003-097283	861. 特願2003-136445
812.	特顧2003-097327	862. 特顧2003-139397
813.	特願2003-101917	863. 特願2003-140684
814.	特顧2003-104928	864. 特顧2003-142303
815.	特願2003-105362	865. 特願2003-143932
816.	特願2003-107267	866. 特願2003-145221
817.	特願2003-107268	867. 特顧2003-145390
818.	特願2003-107647	868. 特願2003-147820
819.	特願2003-107885	889. 特願2003-150690
820.	特願2003-109575	870. 特顯2003-153014
821.	特願2003-115750	871. 特願2003-153015
822.	特願2003-115793	872. 特願2003-153016
823.	特顧2003-115847	873. 特顧2003-153985
824.	特顧2003-115888	874. 特願2003-154009
825.	特願2003-116232	875. 特願2003-154841
826.	特願2003-116895	876、特顧2003-155397
827.	特願2003-118161	877. 特願2003-155407
828.	特願2003-118186	878. 特顧2003-158017
829.	特願2003-119749	879. 特顧2003-161005
830.	特願2003-119930	880. 特願2003-164126
831.	特願2003-120934	881. 特顧2003-170051
832.	特願2003-121233	882. 特顧2003-170324
833.	特願2003-121261	883. 特願2003-170325
834.	特願2003-121273	884. 特願2003-170326
835.	特願2003-121780	885. 特願2003~170327
836.	特願2003-122245	886. 特願2003-170328
837.	特願2003-123984	887. 特顯2003-170329
838.	特願20.03~124654	888. 特顧2003-170330
839.	特願2003-124655	889. 特顯2003-170573
840.	特願2003-124826	890. 特願2003-171576
8 4 1.	特願2003-124829	891. 特願2003-171619
842.	特願2003-124833	892. 特顧2003-172898
843.	特願2003-124835	893. 特願2003-175819
844.	特願2003-125388	894. 特顧2003-177298
845.	特願2003-125403	895. 特願2003-180198
846.	特願2003-125405	896. 特顧2003-182958
847.	特願2003-127090	897. 特願2003-192763
848.	特願2003-127093	898. 特願2003-192775
849.	特願2003-127109	899. 特願2003-194837
850.	特願2003-127130	900. 特願2003-197229



:

目録(10)

901. 特願2003-198340 902. 特願2003-204075 903. 特顧2003-205349 904. 特顧2003-205710 905. 特願2003-206546 906. 特願2003-207698 907. 特願2003-207771 908. 特願2003-207772 特願2003-207850 909. 910. 特願2003-270049 911. 特願2003-271473 912. 特願2003-272421 913. 特願2003-275055 914. 特顧2003-277958 915. 特願2003-279130 916. 特顧2003-283972 917. 特願2003-284055 918. 特願2003-286640 919. 特願2003-289138 920. 特願2003-293912 921. 特願2003-296474 922. 特願2003-298558 923. 特願2003-299424 924. 特願2003-303979 特願2003-304452 925. 特願2003-304453 926. 927. 特願2003-305689 928. 特願2003-305844 929. 特願2003-306137 特願2003-307564 930. 931. 特願2003-313014 特願2003-315355 932. 特願2003-318801 933. 934. 特願2003-321497 935. 特願2003-322948 936. 特願2003-324974 937. 特顧2003-326510 938. 特願2003-327645 939. 特願2003-327907 940. 特願2003-328600 941. 特願2003-328840 942. 特願2003-330418 943_ 特願2003-330569 944. 特願2003-331848 945. 特願2003-332756 特顧2003-333798 946. 特願2003-333932 947. 948. 特願2003-334036 949. 特願2003-334083 950. 特願2003-336365

951. 特願2003-338191 952. 特願2003-339542 953. 特願2003-340181 954. 特願2003-342519



認定・付加情報

特許出願の番号

特願2003-082466

受付番号

2 0 3 0 8 5 5 0 7 8 7

書類名

出願人名義変更届(一般承継)

担当官

野本 治男

2 4 2 7

作成日

平成16年 4月 7日

<認定情報・付加情報> 【提出された物件の記事】

【提出物件名】 委任状(代理権を証明する書面) 1



特願2003-082466

出願人履歴情報

識別番号

[000006792]

1. 変更年月日 [変更理由] 1990年 8月28日

新規登録 埼玉県和光市広沢2番1号

住 所 氏 名

理化学研究所



特願2003-082466

出願人履歴情報

識別番号

[503359821]

1.変更年月日 [変更理由] 住 所 氏 名 2003年10月 1日 新規登録 埼玉県和光市広沢2番1号 独立行政法人理化学研究所